



2021年12月23日

各 位

会 社 名 株式会社フジインコーポレーテッド
代表者名 代表取締役社長 関 敬 史
(コード番号 5384 東証・名証第一部)
問合せ先 財務本部副本部長 川 島 敏 裕
(TEL 052-503-8181)

固定資産（工場用地）の取得に関するお知らせ

当社は、2021年12月21日開催の取締役会における決議に基づき、本日、固定資産（工場用地）の取得に関する売買契約を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得理由

当社は、半導体製造工程で使用されるシリコンウェハー向けラッピング材・ポリシング材および半導体デバイス向けCMP製品等を開発・製造・販売しております。

昨今、当社の顧客であるシリコンウェハーメーカー及び半導体デバイスメーカーは、旺盛な半導体需要に応えるべく、積極的な設備投資計画を公表・実施しております。

このような状況下、当社においても、供給責任を果たすべく、段階的に設備投資を進めております。一方で、将来的に更なる需要増加が見込まれることを鑑み、今回新たに固定資産（工場用地）を取得することといたしました。

2. 取得資産（土地）の内容

所在地	岐阜県各務原市各務西町四丁目・各務山の前町一丁目地内の一部
用途	工場用地
地積	28,120.29 m ²
取得価額	約13億円（全額自己資金）

取得価額は直近連結会計年度の末日における連結純資産の30%未満であります。

3. 相手先の概要

各務原市土地開発公社

4. 今後の見通し

顧客の積極的な設備投資に対し、当社では日本拠点のみならず、台湾および米国拠点においても、適宜、生産能力の増強を進めております。また、顧客の最先端半導体デバイスの開発および量産に対応するため、R&D機能の強化に関しても検討を進めてまいります。

なお、当該固定資産の取得による、当期業績に与える影響は軽微ですが、今後、開示事項に該当する事象が発生しましたら速やかに開示いたします。

以 上